

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行專訴字第19號

民國112年11月23日辯論終結

原告 優尼克生技股份有限公司

代表人 馬瑞玟

訴訟代理人 賴蘇民律師

張東揚律師

複代理人 洪子洵律師

被告 經濟部

代表人 王美花

訴訟代理人 賴榮章

參加人 蔡秀芳

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國112年3月9日經訴字第11217302030號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

甲、程序方面

參加人經合法通知（本院卷第217頁），無正當理由於言詞辯論期日未到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，准原告及被告聲請，由到場之當事人辯論而為判決（本院卷第223頁）。

乙、實體方面

壹、爭訟概要：

原告於民國106年5月4日以「二氧化氯水溶液生產設備」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，申請專利範圍共5項，經編為第106114742號審查，於109年7月10日准予專利，並公告及發給發明第I702185號專利證書（下稱系

爭專利)。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定提起舉發，案經智慧局審查以111年8月31日(111)智專三(五)01190字第11120859230號專利舉發審定書為「請求項1至5舉發不成立」之處分(下稱原處分)。參加人不服，提起訴願，被告於112年3月9日以經訴字第11217302030號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關於6個月內另為適法之處分」(下稱訴願決定)，原告不服提起本訴。本院認為本件判決之結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟(本院卷第153至154頁)。

貳、原告主張及聲明：

一、證據2內容對於系爭專利請求項1「節省測量氧化還原電位單元之數量」、「以單一測量單元同時監測數個容裝槽」之發明目的，未見有任何相關教示或建議，訴願決定逕以若只求達成以若干個反應槽同時生產二氧化氯水溶液為由，即認將氧化還原電位計之安裝位置自反應槽上改為設置在輸送管線上為位置及數量之簡單變更，顯為後見之明，且未詳述系爭專利之發明與證據2間之功能、目的間之共通性及關聯性為何，有理由不備之違法，應予撤銷。

二、系爭專利請求項1與證據2有顯著差異，整體的使用及運作方式均與證據2不同，無法證明系爭專利請求項1不具進步性，且系爭專利請求項1具有便於維修及更換可降低設置設備之固定成本、簡化出貨流程、以不同於現有技術的技術手段監控整體濃度趨勢等有利功效，更具有可大幅降低氧化還原電位量測儀器之使用成本的無法預期功效，具進步性之因素。系爭專利請求項2至5為依附於系爭專利請求項1之附屬項，證據2亦不足以證明系爭專利請求項2至5不具進步性。

三、聲明：訴願決定撤銷。

參、被告答辯及聲明：

一、證據2已經揭示系爭專利請求項1之電解單元、輸混單元、容裝槽組、混合器、電控閥組、測量單元等主要技術特徵；二者差異在於證據2之氧化還原電位監測點45設置在反應槽42

上，系爭專利之測量單元則設置在輸送管線上。依證據2第3圖至第9圖與說明書第[0034]段至第[0037]段等內容，證據2之二氧化氯水溶液產生系統可應用於以單一反應槽來生產二氧化氯水溶液、以若干個反應槽同時生產二氧化氯水溶液，或使若干個反應槽依序作業，不間斷地生產二氧化氯水溶液等不同生產作業模式。系爭專利請求項1之測量單元僅具有以若干個反應槽同時生產二氧化氯水溶液之單一生產模式，而此模式將氧化還原電位計之安裝位置，由設置在反應槽上改為在輸送管線上以簡化設備，僅屬數量及位置之簡單變更。由系爭專利說明書第[0018]段內容，可知氧化還原電位計為商業化之商品，用於管線中測量二氧化氯水溶液之氧化還原電位，屬系爭專利申請時之習知技術，證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

二、證據2之氣壓閥425至428與系爭專利之電控閥組之數個電控閥具有相同功效，系爭專利請求項2以電控閥取代氣壓閥僅為一個具有相同功能之元件的簡單替換，並不具備無法預期功效；證據2之溫度感測器37及其控制功能，可控制電解槽之熱交換作業，相當於系爭專利請求項3之溫控單元；證據2電解液儲存裝置之電解液儲存槽藉由電解液加壓幫浦及輸液管與電解裝置連接，將電解液提供予電解裝置，相當於系爭專利請求項4之送料單元；證據2之清洗裝置可用水清洗電解裝置30，相當於系爭專利請求項5之清洗單元，證據2足以證明系爭專利請求項2至5不具進步性。

三、聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人經合法通知未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何陳述。

伍、爭點（本院卷第180頁）：

證據2是否足以證明系爭專利請求項1至5不具進步性？

陸、本院判斷：

一、系爭專利申請日為106年5月4日，於109年7月10日經審定准予專利（審定卷第20頁、第166頁），是系爭專利有無撤銷

原因，應以核准審定時之108年5月1日修正公布、同年11月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）為斷。而核准時專利法第22條第2項規定：發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。再依同法第71條第1項第1款規定，發明有違反第22條規定之情事，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。準此，系爭專利有無違反核准時專利法第22條第2項規定情事，依法應由舉發人即參加人附具證據證明之。

二、系爭專利技術分析

(一)系爭專利技術內容：

一種二氧化氯水溶液生產設備，包含一個生產裝置，以及一個混合測量裝置。該生產裝置包括一個用來電解一電解液以產生二氧化氯氣體的電解單元。該混合測量裝置連通組接該電解單元，並包括一個能將該電解單元產生的該二氧化氯氣體及水混合成為該二氧化氯水溶液的輸混單元、一個設置在該輸混單元並能量測該二氧化氯水溶液的氧化還原電位的測量單元，以及一個訊號連接該測量單元及該輸混單元的控制單元。系爭專利以該測量單元量測該二氧化氯水溶液之氧化還原電位，能利於該控制單元自動化地控制輸混單元混合生產，具有便於品管及量產之優勢（系爭專利[摘要]，本院卷第241頁）。

(二)系爭專利主要圖式：

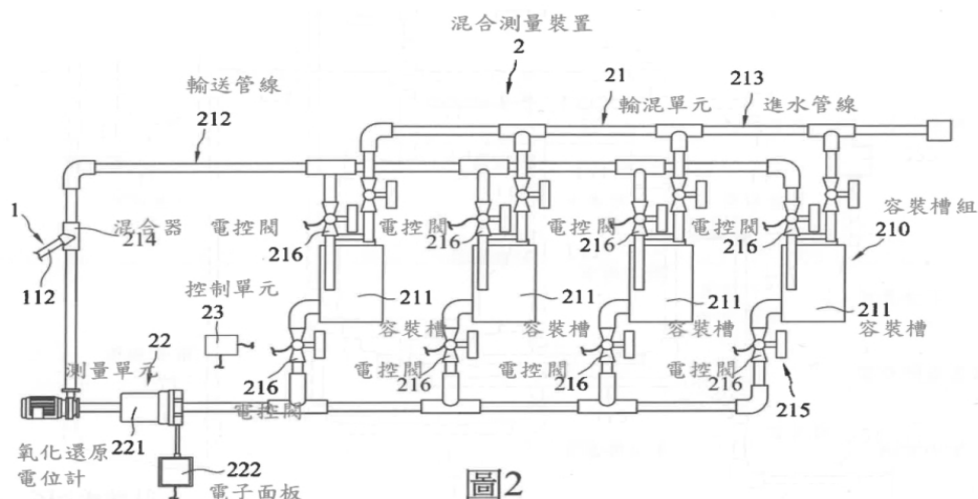


圖2

(三)系爭專利申請專利範圍：

系爭專利公告時申請專利範圍共計5項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，內容如下：

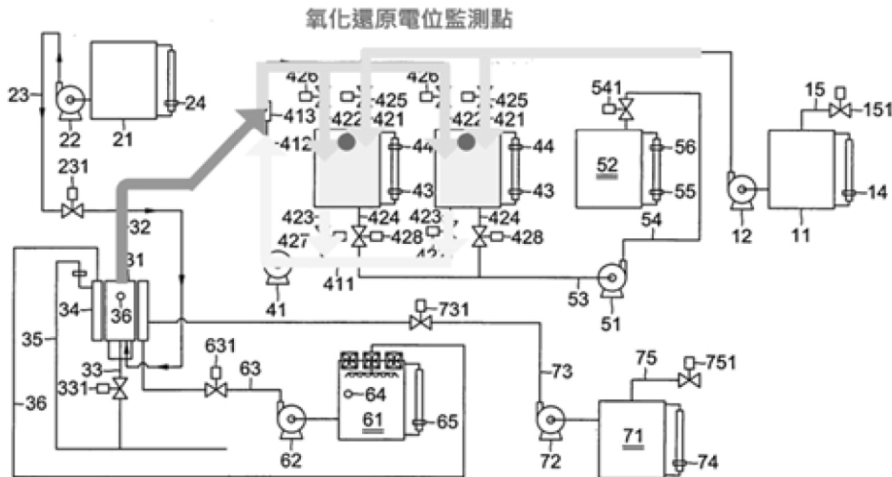
- 1.請求項1：一種二氧化氯水溶液生產設備，適用於利用一電解液及水來製造該二氧化氯水溶液，並包含：一個生產裝置，包括一個用來電解該電解液以產生二氧化氯氣體的電解單元；一個混合測量裝置，包括一個輸混單元、一個設置在該輸混單元上的測量單元，以及一個訊號連接該測量單元及該輸混單元的控制單元，該輸混單元具有一個連通組接該電解單元且能將該二氧化氯氣體及水混合成為該二氧化氯水溶液的混合器、一個組裝連通該混合器的輸送管線、一個組裝連通該輸送管線的容裝槽組，以及一個設置在該輸送管線或該容裝槽組的其中一者的電控閥組，該測量單元設置在該輸送管線上，能量測於該輸送管線中流動的該二氧化氯水溶液的氧化還原電位，並產生一個測量值傳送至該控制單元，該控制單元訊號連接該電控閥組，且能依該測量值及一個內建的預設值的比對結果，開啟或關閉該電控閥組；其中，該容裝槽組包括數個能用來容裝水或二氧化氯水溶液的容裝槽，該輸送管線連通組接於該等容裝槽間，並能將該等容裝槽中所容裝的水或二氧化氯水溶液循環輸送於該混合器及該等容裝槽間。
- 2.請求項2：如請求項1所述的二氧化氯水溶液生產設備，其中，該電控閥組包括數個電控閥，該等電控閥能控制水及該二氧化氯水溶液是否進出該等容裝槽。
- 3.請求項3：如請求項1所述的二氧化氯水溶液生產設備，其中，該生產裝置還包括一個連接該電解單元並能控制該電解單元的溫度的溫控單元。
- 4.請求項4：如請求項1所述的二氧化氯水溶液生產設備，其中，該生產裝置還包括一個連接該電解單元並能將該電解液提供予該電解單元的供料單元。
- 5.請求項5：如請求項1所述的二氧化氯水溶液生產設備，其中，該生產裝置還包括一個連接該電解單元並能用水清洗該

電解單元的清洗單元。

三、舉發證據說明

(一)證據2為106年2月11日公告之我國第I570057號「一種二氧化氯水溶液產生系統」發明專利，其公告日早於系爭專利申請日（106年5月4日），可為系爭專利之先前技術。

(二)證據2主要圖式：



四、爭點分析

(一)證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

1.系爭專利請求項1之技術特徵為：要件1A「一種二氧化氯水溶液生產設備，適用於利用一電解液及水來製造該二氧化氯水溶液，並包含：」、要件1B「一個生產裝置，包括一個用來電解該電解液以產生二氧化氯氣體的電解單元；」、要件1C「一個混合測量裝置，包括一個輸混單元、」、要件1D「一個設置在該輸混單元上的測量單元，」、要件1E「以及一個訊號連接該測量單元及該輸混單元的控制單元，」、要件1F「該輸混單元具有一個連通組接該電解單元且能將該二氧化氯氣體及水混合成為該二氧化氯水溶液的混合器、」、要件1G「一個組裝連通該混合器的輸送管線、」、要件1H「一個組裝連通該輸送管線的容裝槽組，」、要件1I「以及一個設置在該輸送管線或該容裝槽組的其中一者的電控閥組，」、要件1J「該測量單元設置在該輸送管線上，能量測

於該輸送管線中流動的該二氧化氯水溶液的氧化還原電位，」、要件1K「並產生一個測量值傳送至該控制單元，該控制單元訊號連接該電控閥組，且能依該測量值及一個內建的預設值的比對結果，開啟或關閉該電控閥組；」、要件1L「其中，該容裝槽組包括數個能用來容裝水或二氧化氯水溶液的容裝槽，」及要件1M「該輸送管線連通組接於該等容裝槽間，並能將該等容裝槽中所容裝的水或二氧化氯水溶液循環輸送於該混合器及該等容裝槽間」。

2.證據2請求項2、4揭示一種二氧化氯水溶液產生系統，包含電解裝置及反應裝置等，該電解裝置包含有一電解槽，該電解槽設有輸氣管，該輸氣管係用以輸送二氧化氯氣體；反應裝置包含有一加壓幫浦與若干的反應槽，該加壓幫浦設有進水管與出水管，該加壓幫浦之出水管上並設有一氣液混合器，該氣液混合器之進氣端係與電解裝置之輸氣管連接，該反應槽各設有第一入水管、第二入水管、第一出水管、第二出水管等，該第一入水管係與水液儲存槽之輸水管連接，第二入水管係與加壓幫浦之出水管連接，第一出水管係與加壓幫浦之入水管連接，該第一入水管設有氣壓閥，該第二入水管、第一出水管與第二出水管各設有耐酸鹼之氣壓閥，反應槽上並設有氧化還原電位(ORP)監測點。

3.證據2說明書第[0036]段及第5圖揭示同時利用二反應槽42A、42B作反應作業以生產二氧化氯水溶液；藉由上述裝置，開啟二個反應槽42A、42B上所設第一入水管421之氣壓閥425及第二入水管422、第一出水管423之耐酸鹼氣壓閥426、427，控制水液儲存槽11中之RO水液輸入反應裝置40之二個反應槽42A、42B中，然後抽吸二個反應槽42A、42B中所存之水液，使水液經第一出水管423、進水管411、加壓幫浦41、出水管412、氣液混合器413、第二進水管422再循環進入二個反應槽42A、42B中；同時，將電解液輸入電解槽31中電解使產生二氧化氯氣體與鹼性廢液，令該反應生成之二氧化氯氣體輸入輸氣管32中；此時，輸氣管32中之二氧化氯氣體進入

01 氣液混合器413中與水液混合使形成二氧化氯水溶液，令該
02 二氧化氯水溶液得由第二進水管422輸入二反應槽42A、42B
03 中；然後依據所設定之二氧化氯水溶液之濃度，據以控制水
04 液儲存槽11內之水液是否再輸入二反應槽42A、42B中，同時
05 控制反應裝置40之加壓幫浦41是否再抽吸循環反應槽42中之
06 水液流經氣液混合器413，使與二氧化氯氣體再混合以提高
07 濃度；待二反應槽42A、42B中二氧化氯水溶液之濃度到達所
08 需之濃度後，關閉反應裝置40之加壓幫浦41、第一入水管42
09 1上所設之氣壓閥425及第二入水管422、第一出水管423上所
10 設之耐酸鹼氣壓閥426、427，使水液儲存槽11之水液不再輸
11 入二反應槽42中，且反應裝置40所存之二氧化氯水溶液不再
12 循環與二氧化氯氣體混合，使二反應槽42A、42B中二氧化氯
13 水溶液排入成品儲存槽52中存放。證據2說明書第[0041]段
14 揭示較佳之實施例是該反應裝置40之反應槽42上設有氧化還
15 原電位（ORP）監測點45，用以監測反應槽42內氧化還原之
16 特性。

- 17 4.由上可知，證據2揭示二氧化氯水溶液生產設備（二氧化氯
18 水溶液產生系統），適用於利用一電解液及水來製造該二氧
19 化氯水溶液，並包含系爭專利[要件1A]：一個生產裝置（電
20 解裝置），包括一個用來電解該電解液以產生二氧化氯氣體
21 的電解單元（電解槽31）[要件1B]；一個混合測量裝置（反
22 應裝置40），包括一個輸混單元（由氣液混合器413、反應
23 槽42A及42B、連通組接之溶液輸送管線與其控制閥等構成）
24 [要件1C]、一個設置在該輸混單元上的測量單元（設置在反
25 應槽中的氧化還原電位監測點45）[要件1D]，以及對輸混單
26 元予以控制之手段（控制溶液輸送管線上的閥組件之開
27 關），該輸混單元具有一個連通組接該電解單元且能將該二
28 氧化氯氣體與水混合成為該二氧化氯水溶液的混合器（氣液
29 混合器413）[要件1F]、一個組裝連通該混合器的輸送管線
30 （第二入水管422、第一出水管423、進水管411、出水管412
31 等連通組接之溶液輸送管線）[要件1G]、一個組裝連通該輸

送管線的容裝槽組（反應槽42A及42B）[要件1H]，以及一個設置在該輸送管線或該容裝槽組中的一者的閥組（耐酸鹼氣壓閥426及427等閥組件），該測量單元設置在容裝槽上，能量測容裝槽內二氧化氯水溶液的氧化還原電位，並產生一個測量值，且能依該測量值與預設值的比對結果，開啟或關閉該閥組；其中，該容裝槽組包括數個能用來容裝水或二氧化氯水溶液的容裝槽（反應槽42A及42B）[要件1L]，該輸送管線連通組接於該等容裝槽間，並能將該等容裝槽中所容裝的水或二氧化氯水溶液循環輸送於該混合器及該等容裝槽間（反應槽42A、42B中所容裝的水液或二氧化氯水溶液循環流經氣液混合器413及該等反應槽42A、42B間）[要件1M]。

5.系爭專利請求項1與證據2相較，仍存有差異：(1)證據2未具體記載採用一訊號連接之控制單元以開啟或關閉一電控閥組[要件1E、1I、1K]；(2)證據2之氧化還原電位監測點45並非設置於輸送管線上[要件1J]。經查：

(1)關於上開差異(1)，證據2揭示依據所設定之二氧化氯水溶液之濃度，控制水液之輸入與二氧化氯水溶液之循環，待反應槽中二氧化氯水溶液之濃度到達所需之濃度後，關閉耐酸鹼氣壓閥426、427等而使二氧化氯水溶液不再循環與二氧化氯氣體混合；由於氧化還原電位監測點45係用以表徵二氧化氯水溶液之濃度，可知證據2已揭露藉由「氧化還原電位監測點45之量測結果是否達到預設值」控制「溶液輸送管線上的閥組件之開關」。由於氣壓閥與電控閥均為控制管道流體流通的基礎元件而廣泛應用於各類裝置中，二者僅係驅動啟閉的方式有別，發明所屬技術領域中具有通常知識者為實現二氧化氯水溶液生產的自動控制，當可利用申請時之通常知識，於證據2中配置訊號連接之控制單元，並將證據2之氣壓閥簡單地置換為電控閥，使控制單元接收氧化還原電位監測點45之量測結果並與預設值比對，再傳送電子訊號直接驅動電控閥之開啟或關閉[要件1E、1I、1K]。

(2)關於上開差異(2)，證據2說明書第[0036]段揭示反應裝置40所存之二氧化氯水溶液不再循環與二氧化氯氣體混合後，使二反應槽42A、42B中二氧化氯水溶液排入成品儲存槽52中存放；換言之，證據2「同時利用二反應槽42A、42B生產二氧化氯水溶液」的作業模式中，所生產之二氧化氯水溶液成品係由反應槽42A、42B中的二氧化氯水溶液匯合而得，故而於此模式中，僅需確認反應槽42A、42B中的二氧化氯水溶液之「匯流後濃度」達到所需之濃度，即應符合成品要求，並不以準確監測每一反應槽內二氧化氯水溶液濃度為必要。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者為簡化設備配置，當可利用申請時之通常知識，將證據2中個別安裝於每一反應槽中的多個氧化還原監測點45簡單地置換為設置在進水管411上（靠近加壓幫浦41處）的一個氧化還原監測點[要件1J]，以量測流經此處之二氧化氯水溶液的氧化還原電位，即可評估反應槽42A、42B中的二氧化氯水溶液之「匯流後濃度」是否達到標準，使最終二氧化氯水溶液成品具有所需濃度。

6.依上說明，系爭專利請求項1僅為證據2技術內容之簡單變更，且相較於證據2並未見有產生無法預期之功效，故系爭專利請求項1為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2之內容所能輕易完成者，證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

7.原告主張不可採之理由：

(1)原告援引專利審查基準第二篇第三章第3.4.1.2節及本院109年度行專訴字第57號行政判決（下稱甲證4判決），主張以單一引證判斷申請專利之發明是否為簡單變更時，應考量二者間課題及功能的關聯性，以及該引證是否有相關教示云云（本院卷第16至19頁、第183至184頁）。然查：

①甲證4判決理由所示「判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決

技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素」內容（本院卷第74頁），其考量所欲解決之問題是否具有共通性及功能作用是否具有共通性之對象係「複數引證間」，並非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容的關連性或共通性，且係於用以判斷複數引證間是否存在結合動機，而非用以判斷簡單變更，原告擷取甲證4判決部分內容主張以單一引證判斷申請專利之發明是否為簡單變更應考量二者間課題及功能的關聯性，自非可採。

②甲證4判決認該案證據1「抱樁器」之功能在鎖緊浮橋，該案訟爭專利「襯墊板」功能為彌補原主體與固定樁間之間隙，二者功能並不相同（本院卷第74頁）。而本件證據2之氧化還原電位監測點係用以量測二氧化氯水溶液之氧化還原電位，藉由其量測結果控制閥組件之開關，以系統化且大量生產二氧化氯水溶液，系爭專利之測量單元係用以自動化地量測流經的氧化還原電位，並能基於測量結果進一步開啟或關閉電控閥組，達到自動化生產、控制之目的（此觀系爭專利說明書第2至3頁所載內容即明，本院卷第246至247頁），經比對可知證據2「氧化還原電位監測點」與系爭專利「測量單元」之功能目的並無二致，本件與甲證4判決之案情有別，尚難比附援引。

(2)原告主張證據2第11頁末行至第12頁第1行記載使每一反應槽42「依序」進行生產作業，通常知識者並無動機改變證據2之氧化還原電位計設置位置以達到系爭專利之「節省測量單元」、「以單一測量單元同時監測數個容裝槽」之有利功效，並稱參加人及被告未提出「清楚且令人信服」之證據證明云云（本院卷第19至20頁、第184至185頁、第236頁）。惟查：

①證據2說明書第[0036]段及第5圖揭示「同時利用二反應槽42A、42B作反應作業以生產二氧化氯水溶液」，可知訴願決定

01 所述「倘只求達成以若干個反應槽同時生產二氧化氯水溶液
02 之生產模式……」並非以系爭專利發明目的予以反推所得態
03 樣，而係證據2已具體揭示之作業模式。至原告引述之證據2
04 第11頁末行至第12頁第1行「藉由設置若干的反應槽42，使
05 每一反應槽42依序進行生產作業」，乃為證據2說明書第[00
06 37]段及第7圖所記載之另一種作業模式，實則證據2並非僅
07 揭示此作業模式；原告忽略證據2所載其他內容，徒以此作
08 業模式與系爭專利為比對而指稱訴願決定之認定為後見之
09 明，並不可採。

10 ②前述證據2已揭示「同時利用二反應槽42A、42B生產二氧化
11 氯水溶液」的作業模式，藉由「氧化還原電位監測點45之量
12 測結果是否達到預設值」控制「溶液輸送管線上的閥組件之
13 開關」以系統化且大量生產二氧化氯水溶液，且簡化設備配
14 置係屬於眾多技術領域共同所欲解決問題，發明所屬技術領
15 域中具有通常知識者即可基於前述功能目的並考量簡化設備
16 配置之常見課題，將證據2中個別安裝於每一反應槽中的多
17 個氧化還原監測點45簡單地置換為設置在進水管411上（靠
18 近加壓幫浦41處）的一個氧化還原監測點，以更簡易的設備
19 配置而同樣實現二氧化氯水溶液的自動化生產，蓋因流經此
20 處之二氧化氯水溶液的氧化還原電位即足以表徵反應槽42
21 A、42B中的二氧化氯水溶液之「匯流後濃度」是否達到標
22 準，使得最終二氧化氯水溶液成品具有所需濃度，故而應認
23 證據2已達清楚且令人信服之證明程度。

24 ③原告未憑系爭專利說明書，徒以系爭專利申請過程所提申復
25 理由書內容稱系爭專利請求項1之功效為「節省測量氧化還
26 原電位單元之數量」、「以單一測量單元同時監測數個容裝
27 槽」，然前述功效未明確記載於系爭專利申請時說明書、申
28 請專利範圍或圖式，原告亦未陳明如何自系爭專利申請時說
29 明書、申請專利範圍或圖式之記載內容推導得到前述功效，
30 是以判斷進步性時是否應予以考量，已非無疑。縱經考量，
31 惟發明所屬技術領域中具有通常知識者可基於證據2所載功

能目的及簡化設備配置之常見課題，將證據2中個別安裝於每一反應槽中的多個氧化還原監測點予以簡單變更其數量及位置，其理由業如前述；且證據2之輸送管線配置亦有連通氣液混合器413及反應槽42A、42B，則二氧化氯水溶液於其間循環流動時，二氧化氯水溶液濃度同樣可趨動態平衡，而被氧化還原監測點所量測到的氧化還原電位所表徵。因此，「節省測量單元」及「以單一測量單元同時監測數個容裝槽」均難認係發明所屬技術領域中具有通常知識者無法預期者，仍無助於肯認系爭專利之進步性。

(3)原告稱系爭專利請求項1之容裝槽211可兼具混合及容裝包材之雙重功用，證據2用以混合之反應槽42及用以儲存成品之成品儲存槽52係獨立分開；系爭專利請求項1的輸送管線212能將二氧化氯水溶液循環輸送於混合器214及容裝槽211間，證據2中的二氧化氯水溶液僅能單向排入成品儲存槽52，且排入後即無法再循環至氣液混合器413；以及系爭專利請求項1的輸混單元21並未被證據2所揭露云云（本院卷第38頁所列差異說明第②至④點）。經查：

①系爭專利請求項1並未界定容裝槽兼有作為容裝包材之功能，因此只要可供混合及容置二氧化氯水溶液之槽體即足對應於系爭專利請求項1所稱「容裝槽」；由於證據2之反應槽可使自第一入水管及第二入水管輸入的水液及二氧化氯水溶液混合，並可容置二氧化氯水溶液，是以反應槽42A及42B應相當於系爭專利請求項1之「容裝槽」且二者可構成「容裝槽組」，尚無原告所稱差異。

②證據2之反應槽42A及42B相當於系爭專利請求項1之「容裝槽」，其理由業如前述，則證據2揭示反應槽42A、42B中所存之水液經第一出水管423、進水管411、加壓幫浦41、出水管412、氣液混合器413、第二入水管422再循環進入二個反應槽42A、42B，即已表明反應槽42A、42B中所容裝的水液或二氧化氯水溶液可循環流經氣液混合器413及該等反應槽42A、42B間，亦無原告所指差異。

01 ③證據2之二氧化氯水溶液產生系統包含氣液混合器、反應
02 槽、連通組接之溶液輸送管線與其控制閥等元件，前述元件
03 之配置可使二氧化氯氣體與水液混合，亦可輸送二氧化氯水
04 溶液，即構成一具有輸送及混合作用的單元，顯見證據2確
05 已揭露相當於系爭專利請求項1所稱「輸混單元」之配置。

06 (4)原告稱系爭專利請求項1之測量單元22設置在輸送管線212
07 上，但證據2的氧化還原監測點45設置在反應槽42中；系爭
08 專利請求項1的控制單元並未被證據2所揭露；系爭專利請求
09 項1的閥為電控閥，而證據2的閥為氣壓閥，且由於證據2未
10 揭露控制單元23，故證據2的閥理應非電控閥，因此系爭專
11 利請求項1的電控閥組215並未被揭露云云（本院卷第38頁所
12 列差異說明第①、④及⑤點）。惟發明所屬技術領域中具有
13 通常知識者可將證據2氧化還原監測點的安裝位置自設置於
14 反應槽上改為設置於進水管411上（靠近加壓幫浦41處），
15 且可於證據2中配置訊號連接之控制單元，並將證據2之氣壓
16 閥簡單地置換為電控閥，其理由業如前述。因此，即使系爭
17 專利請求項1與證據2間存在前開差異，仍僅屬證據2技術內
18 容之簡單變更。

19 (5)原告主張系爭專利之容裝槽211中的二氧化氯水溶液濃度到
20 達標準後，該等容裝槽211即可當作包材卸下直接發貨給客
21 戶，反觀證據2之反應槽不可能直接卸除發貨給客戶，是以
22 證據2需另外設置儲存裝置50，先以成品儲存槽52儲存二氧
23 化氯水溶液，再另行包裝出貨，因此系爭專利請求項1與證
24 據2之整體使用及運作方式均不同云云（本院卷第38至39
25 頁）。然發明所屬技術領域中具有通常知識者可將證據2中
26 個別安裝於每一反應槽中的多個氧化還原監測點45簡單地置
27 換為設置在進水管411上（靠近加壓幫浦41處）的一個氧化
28 還原監測點，其理由業如前述。由於系爭專利請求項1係以
29 開放式連接詞界定二氧化氯水溶液生產設備包含之組件，未
30 排除其他組件之設置，且系爭專利請求項1亦無敘及將容裝
31 槽當作包材卸下直接發貨給客戶之技術特徵，是以縱使證據

2經前述簡單變更所得二氧化氯水溶液產生系統尚包括儲存裝置50，且係將反應槽42A、42B中的二氧化氯水溶液匯流至成品儲存槽52再另行包裝出貨，非將反應槽42A、42B卸下直接發貨，該系統仍與系爭專利請求項1界定內容相符，原告以系爭專利請求項1所未記載之技術特徵為據，稱其與證據2有創作概念根本上之不同，其主張尚非可採。

(6)原告主張以參加人於訴願理由書所述內容而論，系爭專利所屬技術領域的通常知識會強烈地勸阻通常知識者將氧化還原電位量測的儀器設置在管線上，並無動機將證據2的氧化還原電位監測點45由反應槽42改為設置在管線上云云（本院卷第39頁）。惟如前所述，於證據2「同時利用二反應槽42A、42B生產二氧化氯水溶液」的作業模式中，所生產之二氧化氯水溶液成品係由反應槽42A、42B中的二氧化氯水溶液匯合而得，故而於此作業模式中，無論各反應槽間是否存在濃度差異，所著重者仍應係反應槽42A、42B中的二氧化氯水溶液之「匯流後濃度」；只要「匯流後濃度」達到所需之濃度，即應符合成品要求，並不以準確監測每一反應槽內二氧化氯水溶液濃度為必要。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可基於簡化設備之考量，將證據2中個別安裝於每一反應槽中的多個氧化還原監測點45簡單地置換為設置在進水管411上（靠近加壓幫浦41處）的一個氧化還原監測點，經此等數量及位置之簡單變更後的系統仍得以監控二氧化氯水溶液濃度趨勢（反應槽42A、42B中的二氧化氯水溶液之「匯流後濃度」），進而確認最終二氧化氯水溶液成品具有所需濃度，尚無原告所稱「強烈地勸阻通常知識者將氧化還原電位量測的儀器設置在管線上」等情，原告主張不可採。

(7)原告主張系爭專利請求項1具有便於維修及更換、可降低設置設備之固定成本（無需設置成品儲存槽）、簡化出貨流程（可直接封裝出貨）、以不同於現有技術的技術手段監控整體濃度趨勢等有利功效，更具有可大幅降低氧化還原電位量測儀器之使用成本的無法預期功效，有可肯定進步性之因素

01 存在云云（本院卷第39至41頁、第188頁）。然系爭專利請
02 求項1未排除其他組件之設置，亦無敘及將容裝槽當作包材
03 卸下直接發貨給客戶等技術特徵，尚難將「無需設置成品儲
04 存槽」、「可直接封裝出貨」視同有利功效甚至無法預期之
05 功效。再者，系爭專利請求項1與證據2同為監控二氧化氯水
06 溶液生產設備中的二氧化氯水溶液之濃度趨勢，以實現二氧
07 化氯水溶液的自動化生產，並未見有更佳效果而難謂具備有
08 利功效。發明所屬技術領域中具有通常知識者可將證據2中
09 個別安裝於每一反應槽中的多個氧化還原監測點予以簡單變
10 更其數量及位置，理由業如前述，則減少氧化還原監測點可
11 節省儀器使用成本，以及設置於輸送管線上的氧化還原監測
12 儀器相較於設置在槽內者更便於維修或更換等，均為發明所
13 屬技術領域中具有通常知識者可得預期。依上所述，系爭專
14 利請求項1相較於證據2實未見有產生何種無法預期之功效的
15 顯著提升或新的功效，原告之主張礙難憑採。

16 (二)證據2亦足以證明系爭專利請求項2至5不具進步性：

- 17 1.系爭專利請求項1之技術特徵，以及所屬技術領域中具有通
18 常知識者可將證據2所揭示二氧化氯水溶液產生系統進行簡
19 單變更而完成系爭專利請求項1之理由，業如前述。
- 20 2.系爭專利請求項2為請求項1之附屬項，進一步界定「該電控
21 閥組包括數個電控閥，該等電控閥能控制水及該二氧化氯水
22 溶液是否進出該等容裝槽」。承前所述，證據2已揭示控制R
23 0水輸入反應槽之氣壓閥425、以及控制二氧化氯水溶液進出
24 反應槽之耐酸鹼氣壓閥426、427等，且發明所屬技術領域中
25 具有通常知識者可將證據2之氣壓閥簡單地置換為電控閥，
26 並未產生無法預期之功效，故證據2足以證明系爭專利請求
27 項2不具進步性。
- 28 3.系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，進一步界定「該生產
29 裝置還包括一個連接該電解單元並能控制該電解單元的溫度
30 的溫控單元」。查證據2請求項3揭示其電解裝置之電解槽上
31 設有溫度感測器，且依其說明書第[0040]段所載「……該電

01 解裝置30之電解槽31上設有溫度感測器37，該溫度感測器37
02 可偵測電解槽31之溫度，藉以控制冷卻裝置60對電解槽31作
03 熱交換作業之啟閉者」等技術內容可知，證據2之溫度感測
04 器37及其控制功能可控制電解槽之熱交換作業，相當於前述
05 「溫控單元」，故證據2足以證明系爭專利請求項3不具進步
06 性。

07 4.系爭專利請求項4為請求項1之附屬項，進一步界定「該生產
08 裝置還包括一個連接該電解單元並能將該電解液提供予該電
09 解單元的供料單元」。查證據2請求項2揭示二氧化氯水溶液
10 產生系統亦包含電解液儲存裝置，係用以儲存電解液以供電
11 解裝置電解使用包含有一電解液儲存槽，該電解液儲存槽連
12 接有一電解液加壓幫浦，該電解液加壓幫浦並連接有輸液
13 管，該輸液管係與電解裝置連接，亦即證據2電解液儲存裝
14 置之電解液儲存槽藉由電解液加壓幫浦及輸液管與電解裝置
15 連接，將電解液提供予電解裝置，相當於前述「供料單
16 元」，故證據2足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

17 5.系爭專利請求項5為請求項1之附屬項，進一步界定「該生產
18 裝置還包括一個連接該電解單元並能用水清洗該電解單元的
19 清洗單元」。查證據2請求項2揭示二氧化氯水溶液產生系統
20 亦包含清洗裝置，且依其說明書第[0039]段所載「……當完
21 成二氧化氯水溶液生成作業後，開啟電解裝置30之排放管33
22 上所設氣壓閥331，將電解裝置30經電解後所生成之鹼性廢
23 液予以流出排離，接著開啟清洗裝置70之清水加壓幫浦72及
24 輸水管73所設氣壓閥731，令清水槽71中之水液得藉由清水
25 加壓幫浦72之抽吸而經抽水管73、清水加壓幫浦72、輸水管
26 73輸入電解裝置30中，藉以清洗殘留於電解裝置30中之鹼性
27 廢液，然後該鹼性廢液及清洗水即可由排放管33、排出管35
28 排出」等技術內容可知，證據2之清洗裝置可用水清洗電解
29 裝置30，相當於前述「清洗單元」，故證據2足以證明系爭
30 專利請求項5不具進步性。

柒、綜上所述，證據2足以證明系爭專利請求項1至5不具進步性，系爭專利請求項1至5違反核准時專利法第22條第2項規定，原處分所為「請求項1至5舉發不成立」之處分，自有未洽，訴願決定予以撤銷，並命原處分機關於6個月內另為適法之處分，並無違誤。原告訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。

捌、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，均核與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

玖、據上論結，原告之訴為無理由，爰依110年12月8日修正公布之智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第385條第1項前段規定，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 12 月 14 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 蔡惠如

法 官 吳俊龍

法 官 陳端宜

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代

者，得不委任律師為訴訟代理人	理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 112 年 12 月 14 日

書記官 吳社瑩